

■ 特別技術功労賞

しとみ ひろし
蒔 洋 司

独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 研究員

分光反射率標準および標準白色板のトレーサビリティ体系の確立

蒔氏は、光計測技術の基盤である測光・放射標準の研究開発、特に、耐候性試験の評価等で必須となる測色技術（物体色測定）の基盤である分光反射率測定に関して多くの研究成果を挙げており、プラスチック、塗料、繊維、印刷、金属などに代表される多くの産業界が長年待ち望んでいた分光反射率標準を確立すると共に、分光反射率標準にトレーサブルな標準白色板の校正体系を日本において確立するなど、関連産業界に対する貢献は多大である。また、一連の研究成果を基に、測定法の国際規格化に対する活動にも積極的に参画しており、国際照明委員会(CIE)においては、測定法を取り扱う第2部会の日本代表委員として、国内意見の収集・発信・反映に向けた努力を続けているほか、反射率の測定に関連したTC委員としても活動している。また、物体色測定に係るJIS改正に尽力するなど、国内での規格策定に係る活動も行っている。さらに、貴財団の学術講演会をはじめとして、正しい測定法、標準化、トレーサビリティなどに対する啓蒙・普及活動にも力を注いでおり、幅広い分野に対して貢献を果たしている。

（推薦団体：社団法人 日本照明委員会）

（所属・肩書きは受賞決定当時 敬称略）